Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, …..sierpnia 2015 r.

DBA-2/240-39/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę spektrometru ICP OES dla laboratorium **Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** z siedzibą w Lublinie.

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr ICP-OES z podwójnym systemem niejednoczesnej obserwacji plazmy ? Przy jednoczesnym pomiarze z obserwacją pionową i poziomą zakres spektralny spektrometrów ICP-OES jest ograniczony poniżej 500 nm i pozwala jedynie na oznaczanie trzech pierwiastków: sodu, potasu i litu. Do wykonania oznaczeń zgodnych z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12 i SIWZ nie jest wymagany spektrometr ICP-OES z podwójnym systemem jednoczesnej obserwacji.Z powodzeniem oznaczenia wspomnianych pierwiastków można przeprowadzić na spektrometrze ICP-OES z podwójnym systemem niejednoczesnej obserwacji plazmy w takim samym czasie i zakresie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający dopuszcza spektrometr ICP-OES z podwójnym systemem obserwacji plazmy, gdzie odczyt dla obserwacji radialnej i osiowej odbywają się niejednocześnie, ale wymagane jest, aby oba tryby obserwacji mogły być zastosowane w ramach jednego cyklu pomiarowego oraz żeby przełączanie sposobu obserwacji odbywało się w sposób automatyczny, zapisany w parametrach metody.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza spektrometr z generatorem półprzewodnikowym o mocy regulowanej w zakresie 750-1500W i optymalizowanej w przypadku obserwacji podwójnej na 1350W.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza spektrometr z generatorem półprzewodnikowym o mocy regulowanej w zakresie 750-1500 W.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga spektrometru z podwójnym: aksjalnym i radialnym systemem obserwacji palnika poziomego?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wymaga spektrometru z podwójnym: aksjalnym i radialnym systemem obserwacji plazmy.

Pytanie 4

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrometr z możliwością rejestracji widm z obu podglądów plazmy, pionowego i poziomego w dwóch niezależnych etapach.

W każdej opracowanej metodzie pomiarowej, zbieranie danych pomiarowych odbywa się w sposób zdefiniowany przez użytkownika, który przed pomiarem decyduje o sposobie zbierania podglądu plazmy – podgląd poziomy, podgląd pionowy lub oba podglądy jeden po drugim.

Pomiar z podglądu poziomego oraz pionowego w dwóch oddzielnych krokach jest pomiarem czulszym niż pomiar jednoczesny. Wynika to z faktu, że czułość oznaczania stężeń przy równoczesnym sposobie pomiaru w podglądzie aksjalnym jest zmniejszona dla pierwiastków, których linie analityczne są w zakresie fal dłuższych niż 500 nm., zaś dla równoczesnego pomiaru radialnego mamy do czynienia ze spadkiem czułości dla pomiaru linii analitycznych w zakresie fal krótszych niż 500 nm.

Dalszy ciąg pytania może wskazywać źródło zapytania.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ofertę na spektrometr ICP-OES z podwójnym systemem obserwacji plazmy, gdzie odczyt dla obserwacji radialnej i osiowej odbywają się niejednocześnie, ale wymagane jest, aby oba tryby obserwacji mogły być zastosowane w ramach jednego cyklu pomiarowego oraz żeby przełączanie sposobu obserwacji odbywało się w sposób automatyczny, zapisany w parametrach metody.

Pytanie 5

Czy wyrażają Państwo zgodę na dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego palnika plazmowego zamiast dodatkowej rurki centralnej jako części zamiennej?

Dalszy ciąg pytania może wskazywać źródło zapytania.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego palnika plazmowego zamiast dodatkowej rurki centralnej jako części zamiennej.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi na pytania Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ):

1. dotychczasowy zapis: plazma z podwójnym systemem jednoczesnej obserwacji w trybie pionowym (aksjalnym) i poziomym (radialnym)

Otrzymuje brzmienie:

plazma z podwójnym systemem obserwacji w trybie aksjalnym i radialnym

2. dotychczasowy zapis: półprzewodnikowy generator działający z częstotliwością minimum 25 MHz i mocy w zakresie minimum 1200-1600 W chłodzony wodą

Otrzymuje brzmienie:

półprzewodnikowy generator działający z częstotliwością minimum 25 MHz i mocy w zakresie minimum 1200-1500 W chłodzony wodą,

3. dotychczasowy zapis: rurka centralna palnika – 1 szt.

Otrzymuje brzmienie:

rurka centralna palnika lub dodatkowy nierozbieralny palnik plazmowy – 1 szt.

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część, jednakże ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu, w związku z czym dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **15 września 2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 15 września 2015 r. godz. 11:30.**

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony aktualny Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający wszystkie dokonane zmiany.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak